



فصلنامه علمی ((دفاع هوافضایی))

دوره ۱، شماره ۲، شهریور ۱۴۰۱



مقاله پژوهشی

تغییر شکل هندسی نانوذرات در لایه‌های نانوساختار کبالت سلنید با تغییر دما در موج برها

نادر قبادی^۱، سیدعلی حسینی مرادی^۲

۱- دانشیار، گروه فیزیک، دانشگاه ملایر، ایران،

۲- دانشجوی دکترای فیزیک، گروه فیزیک، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

اطلاعات مقاله

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

در این کار نقش دما در تغییر شکل هندسی نانوذرات کبالت سلنید که در معرض امواج الکترومغناطیسی در موج برها قرار دارد، بررسی شده است. داده‌های آزمایشگاهی نشان داده است که دما نقش تعیین‌کننده‌ای روی اندازه گاف انرژی نواری و شکل هندسی آن‌ها دارد. روش ساده‌ای برای ساخت لایه‌های نانوساختار کبالت سلنید با روش رسوب‌گیری از محلول شیمیائی به کار برده شده است. لایه‌های نازک نانوساختار کبالت سلنید با ابزارهای اندازه‌گیری مانند پراش اشعه ایکس جهت تعیین نوع ساختار، EDX برای آنالیز عنصری، میکروسکوپ الکترونی رویشی برای مشاهده ریخت‌شناسی لایه‌ها و اسپکتروسکوپی جذب ناحیه مرئی – فرابنفش برای اندازه‌گیری گاف انرژی نواری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی تغییر شکل نانوذرات را تحت تأثیر دما به خوبی نشان می‌دهد.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

کلمات کلیدی:

رسوب گیری از حمام شیمیائی،
دمای رسوب گیری، گاف انرژی
نوری، تغییر شکل هندسی.



نویسنده مسئول:

نادر قبادی

ایمیل:

n.ghobadi@malayeru.ac.ir

استناد به مقاله: نادر قبادی، سید علی حسینی مرادی، تغییر شکل هندسی نانوذرات در لایه‌های نانوساختار کبالت

سلنید با تغییر دما در موج برها، مجله علمی پژوهشی دفاع هوافضایی دوره ۱، شماره ۲، شهریور ۱۴۰۱.



Journal of Aerospace Defense

Vol. 1, No, 2, 1401



Research Paper

Nanoparticle Geometrical Shape evolution in Cobalt Selenide nanostructure thin films with temperature changing

Nader Ghobadi, Seyed Ali Hoseini Moradi

1- Assistant Professor, Department of Physics, Malayer University, Iran

2- PhD student in Physics, Department of Physics, Malayer University, Iran

Article Information**Accepted:** 1401/02/23**Received:** 1400/07/12**Keywords:**

Shape evolution.

Chemical Bath

Deposition, Deposition
temperature, Energy band gap,
Geometrical**Corresponding author:**

Nader Ghobadi

Email:

n.ghobadi@malayeru.ac.ir

Abstract

In this work the temperature role on the evolution of the nanoparticle geometrical shape in CoSe nanoparticle arrays have been investigated. The data showed that temperature can affect the optical band gap, surface morphology and shape but the deposition temperature plays a crucial role in the shape controlling. We present a simple solution processed synthesis route for CoSe nanostructure thin films using chemical bath deposition method. The films were characterized by X-ray diffraction (XRD) for structure characterization, UV-visible spectroscopy for band gap determination, EDAX technique for elemental analysis and scanning electron microscopy (SEM). SEM pictures show nanoparticles shape with temperature.

HOW TO CITE: Nader Ghobadi, Seyed Ali Hoseini Moradi, Nanoparticle Geometrical Shape evolution in Cobalt Selenide nanostructure thin films with temperature changing, , Vol. 1, No, 2, 1401.

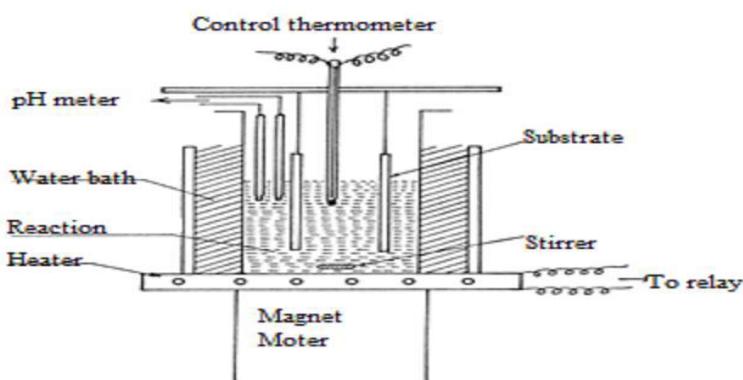
۱. مقدمه

کیالت سلنید یک ماده نیمه‌رسانا با گاف انرژی کوچکی بین ۱ تا ۲ الکترون‌ولت است و کاربردهایی در زمینه اپتوالکترونیک و پدیده فتوولتائیک و باتری‌های خورشیدی دارد. چند دهه گذشته نانوبولوها به با اشکال متفاوت ساخته شده‌اند به ویژه اشکالی مانند نقاط کوانتمومی، نانوسیم‌ها، نانومیله، نانومکعب، نانوکره‌ها و اشکال متقارن و نامتقارن دیگر.

خواص مواد نیمه‌رسانا به شدت تحت تأثیر شکل هندسی آن‌ها هستند. بررسی فرآیندهای رشد که نانوساختارها را با اشکال مختلف می‌سازند بسیار حائز اهمیت است. رشد مواد نانوساختار شامل فرآیند ترسیب ماده جامد از فاز محلول است. درک با مفهومی از فرآیند رشد و کنترل پارامترهای تهیه می‌تواند ما را در کنترل شکل و اندازه ذرات یاری کند [۱ و ۲].

دما یکی از پارامترهایی است که نقش مؤثری در کنترل شکل نانوبولورها دارد. فرآیند ترسیب در هر دمایی شکل ویژه‌ای به هر ترکیبی می‌دهد و ترکیب‌های متفاوت ممکن است در یک دمای ثابت شکل‌های متفاوتی به خود بگیرند.

توصیف روش رسوب‌گیری از محلول شیمیائی به صورت علمی، اولین بار توسط چوپرا و همکارانش در سال ۱۹۸۲ ارائه شد [۳]. روش رسوب‌گیری از محلول شیمیائی به ابزار پیچیده مانند سیستم خلا و سایر تجهیزات گران قیمت نیاز ندارد. در این روش تجهیزات ساده مانند صفحه گرم با همزن مغناطیسی، مواد شیمیائی که به طور معمول ارزان و قابل دسترسی است، موردنیاز است. اساس این روش به این صورت می‌باشد که محلول‌های به وجود آورده لایه‌نازک مرکب در داخل ظرف ریخته می‌شوند و بعد زیر لایه به طور عمودی در ظرف حاوی محلول فرو برده و ثابت نگه داشته می‌شود. ماده موردنظر روی زیر لایه به طور یکنواخت می‌نشیند. شکل ۱ ابزارهای آزمایشگاهی موردنیاز برای روش رسوب‌گیری از محلول شیمیائی را نشان می‌دهد [۴].



شکل ۱: ابزارهای مورداستفاده در روش رسوب‌گیری از محلول شیمیائی

یک کار پژوهشی معروف وجود دارد که در آن رابطه‌ای به اثبات رسیده که نشان می‌دهد هرگاه اندازه ذرات در محدوده نانو کوچک‌تر شوند، اندازه گاف انرژی نواری افزایش می‌یابد. رابطه زیر این ارتباط را نشان می‌دهد:

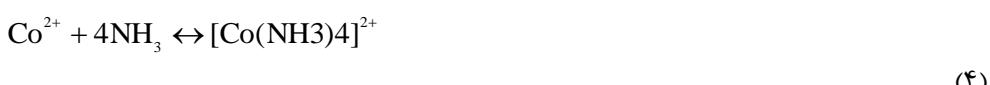
$$E_R = E_g + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2R^2} [1/m_e + 1/m_h] - 1.8e^2 / \epsilon R \quad (1)$$

E_g گاف انرژی نواری در حالت توده‌ای یا همان مقدار در حالت اندازه مایکروسکوپی است. R اندازه ذره، ϵ ثابت دیالکتریک، m_e و m_h جرم الکترون و جرم حفره و e بار الکتریکی است و قسمت سوم رابطه نیروی برهمنش کولنی بین الکترون و حفره است [۵].

۲. روش آزمایشگاهی

برای تهیه فیلم‌های نازک CoSe رسوب داده شده بر روی زیرلایه شیشه از ماده استات سرب (Co(CH₃COO)₂)، آمونیاک (NH₄OH)٪ ۰.۲۵ و محلول تازه آماده شده سدیم سلنیوم سولفیت (Na₂SeSo₃) استفاده می‌کنیم. لازم به ذکر است که همه مواد شیمیایی استفاده شده در این پژوهش از شرکت مرک آلمان خریداری شده‌اند. ابتدا زیر لایه‌هایی به ابعاد ۱۰۶ × ۲۶ × ۷۶ (میلی‌متر) درون یک بشر حاوی الكل (اتانول) و آب مقطر به نسبت ۱ به ۲، قرار می‌دهیم. ظرف حاوی زیرلایه‌ها را درون دستگاه التراسونیک قرار می‌دهیم تا کاملاً تمیز شوند. برای تهیه محلول حاوی کمپلکس تترا آمین روی ۵۰ ml از محلول ۰/۲۲ مول استات کپالت حل شده در آب مقطر شش بار تقطیر را، درون یک بشر ۲۰۰ ml ریخته و بشر حاوی محلول را بر روی هیتر گذاشته و آمونیاک را قطره‌قطره با آن اضافه می‌کنیم تا با مگنت به هم بخورد. در ابتدا محلول ما رنگ قهوه‌ای روشن به خود می‌گیرد و پس از اضافه شدن آمونیاک، رسوب تیره‌رنگی می‌دهد که به خاطر تشکیل ماده Co(OH)₂ است. در ادامه با اضافه کردن بیشتر آمونیاک به محلول، رسوب تیره‌رنگ حل شده و محلول شفاف می‌شود که حاکی از تشکیل کمپلکس تترا آمین سرب (Co(NH₃)₄+2) می‌باشد. برای تهیه محلول ۰/۱۵ مول سدیم سلنیوم سولفیت (Na₂SeSo₃) ابتدا ۵۰ ml از محلول حل شده Na₂So₃ را بر روی هیتر گذاشته و اجازه می‌دهیم که با مگنت به هم خورده و کامل حل شود. در ادامه پودر سلنیوم را به آن اضافه می‌کنیم و محلول فوق را به مدت ۸ الی ۱۰ ساعت در دمای ۸۰ درجه پخت می‌دهیم. سپس محلول تیره‌رنگ را دو بار از کاغذ صافی عبور می‌دهیم تا شفاف شود. در مرحله بعد محلول‌های ساخته شده با pH های دلخواه را درون بشرهایی که زیر لایه‌های شیشه‌ای تحت زاویه ۲۰ درجه با دیواره بشر قرار داده شده‌اند می‌ریزیم و اجازه می‌دهیم تا نانوذرات CoSe رشد کنند [۳]. برای کنترل دما هنگام رسوب گیری، بشرهای حاوی زیرلایه‌ها را درون آون با دمای دلخواه قرار می‌دهیم. ضخامت لایه‌ها از روش اختلاف جرم محاسبه می‌شود به‌این ترتیب که با داشتن جرم لایه اندازه گیری شده با ترازوی حساس و مساحت زیرلایه مربوط از رابطه $t = \frac{m}{\rho A}$ ضخامت با تقریب قابل‌غماصی قابل محاسبه است. m جرم لایه، A مساحت لایه و ρ چگالی ماده موردنظر است که در مورد کپالت سلنید مقدارش ۷/۶۵ گرم بر سانتی‌مترمکعب است.

روابط شیمیائی حاکم بر تشکیل کبالت سلنید از محلول‌ها به شرح زیر است به این صورت که یون‌های با بار مثبت کبالت به‌آرامی از کمپلکس آزاد شده و با یون با بار منفی سلنید ترکیب و ماده کبالت سلنید را تشکیل می‌دهند. در ذیل این روابط آورده می‌شود:

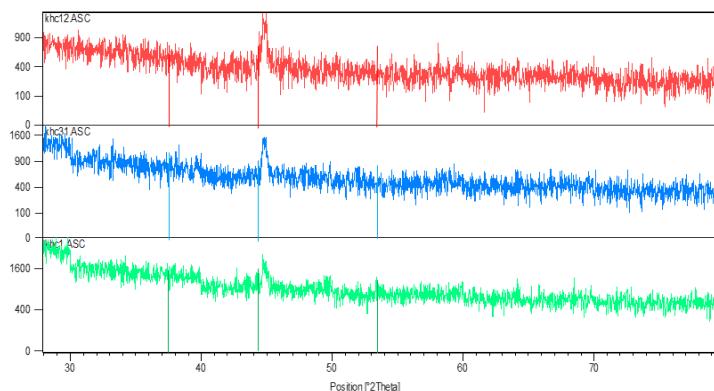


نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که زمان رسوب‌گیری هنگامی آغاز می‌شود که مقدار حاصل‌ضرب غلظت یون‌های کبالت و سلنید، از مقدار حاصل‌ضرب حلالیت کبالت سلنید بیشتر شود و این کمیت بسیار مهمی است که می‌توان برای کنترل ضخامت و آرایش لایه‌ها به کار برد.

۳. مطالعه ساختاری

۱-۳ پراش اشعه ایکس

شکل ۲ طرح پراش اشعه ایکس لایه‌های نانوساختار سلنید کبالت که نشان می‌دهد نمونه‌ها خالص هستند. محصولات دارای پیک‌هایی متناظر با سلنید کبالت هگزاگونال (space group: P63/mmc) (JCPDS 01-00-015-0464) با $a = b = 3.6315 \text{ \AA}$ و $c = 5.3011$ توافق دارد. با ثابت‌های شبکه KCl و NaCl نشان می‌دهد محصولات به خوبی بلورین نشده‌اند.



شکل ۲: طرح پراش اشعه ایکس نمونه‌های با ۱۶ ساعت رسوب‌گیری در دماهای ۳۰۳، ۳۱۳ و ۳۲۳ کلوین از بالا به پایین

۲-۳ مطالعات اپتیکی

در نیمرساناهای بلوری رابطه زیر برای ضریب جذب با انرژی فوتون نوشته می‌شود [۶]:

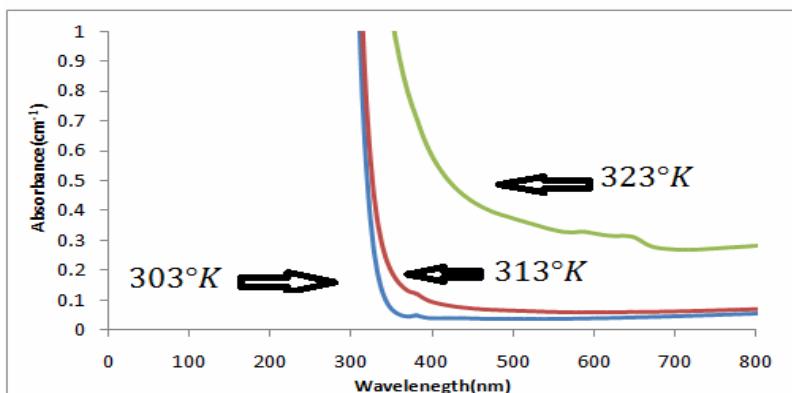
$$\alpha(v)hv = B(hv - E_{gap})^n \quad (6)$$

گاف نواری و B یک ثابت است. hv انرژی فوتون و α ضریب جذب است که با قانون بیر-لامبرت به ضخامت d بستگی دارد. n نوع گذار در نیمه رساناهای را مشخص می کند که $n=2$ برای نیمه رساناهای گاف انرژی غیر مستقیم و $n=1/2$ برای نیمه رساناهای گاف انرژی مستقیم است و چندین گذار دیگر که در مرجع [6] به طور کامل بیان شده است.

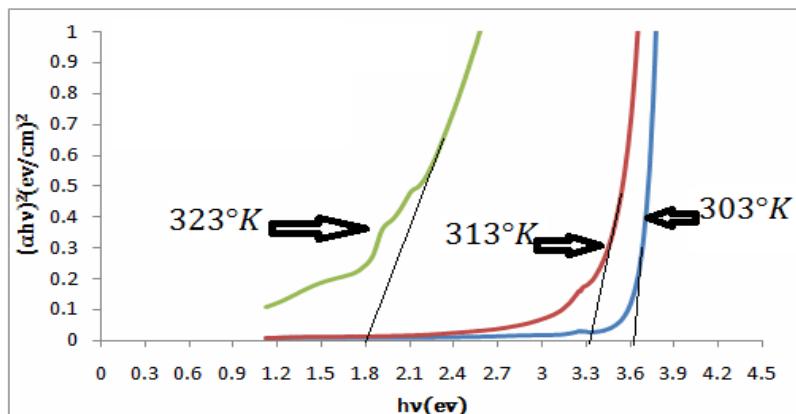
برای تعیین گاف انرژی نواری نانو ذرات کپالت سلنید با استفاده از دستگاه UV-Vis مدل USA-Perkin elmer, Spectro photometer Lambda 25 گرفته ایم. شکل ۳ نمودار $(\alpha hv)^2$ بر حسب (hv) را نشان می دهد. برای تخمین گاف انرژی نواری کافی است خطی ترین قسمت نمودار را برونویابی نماییم، محل برخورد با محور (hv) مقدار گاف انرژی نواری را به دست می دهد. قبل از دانستیم که کپالت سلنید یک نیمه رسانای گاف انرژی مستقیم است و در رابطه $n=1/2$ هر چند در بررسی های تجربی باید همه گذارها با n های متفاوت در نظر گرفته شود و درنهایت خطی ترین نمودار برای محاسبه به کار گرفته شود، برای کپالت سلنید ساخته شده با روش رسوب گیری از محلول شیمیائی $n=1/2$ است.

نمودار شکل ۳ طیف جذبی بر حسب طول موج هر سه نمونه در سه دمای مختلف ۳۰۳، ۳۱۳ و ۳۲۳ کلوین را نمایش می دهد. مشاهده می شود که نمودارها یک جابجایی طول موج را به طرف ناحیه قرمز نمایان است، که ناشی از قرار گرفتن اندازه ذرات در محدوده کوانتموی است به این معنی، پدیده فوق زمانی برای یک ماده رخ می دهد که اندازه ذرات در طیفها تغییر می کند در حالی که اگر ماده به اندازه های میکرو برسد این پدیده رخ نمی دهد و جابجایی در طیف جذبی مشاهده نخواهد شد.

در شکل ۴ نمودار $(\alpha hv)^2$ بر حسب انرژی (الکترون ولت) برای نمونه ها با دماهای مختلف رسم شده است. وابستگی گاف انرژی نواری به تغییرات دما قابل مشاهده است. هر اندازه دما بالاتر رفته است اندازه گاف انرژی کاهش یافته است و از مقدار $3/6$ الکترون ولت در دمای 303 به $3/31$ الکترون ولت در دمای 313 و $1/8$ الکترون ولت در دمای 323 کلوین رسیده است. لایه های تشکیل شده از نانوذرات نیمه رسانای کپالت سلنید اثر محدودیت کوانتموی را به خوبی نمایش می دهد به این معنی که با کوچک شدن اندازه ذرات، گاف انرژی نواری افزایش یافته و تابعیتی از اندازه ذرات گرفته است زیرا تا قبل از ظهرور نانوتکنولوژی کمیت گاف انرژی نوری ثابت فرض می شد.



شکل ۳: نمودار طیف جذبی بر حسب طول موج نمونه های با ۱۶ ساعت رسوب گیری در دماهای رشد ۳۰۳، ۳۱۳ و ۳۲۳ کلوین



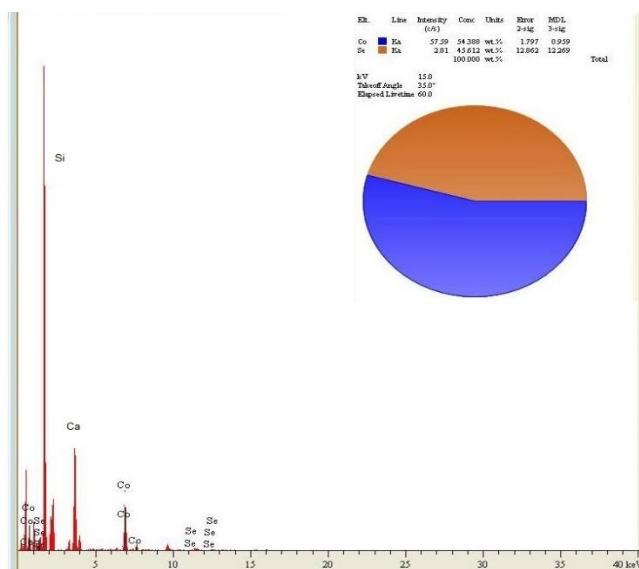
شکل ۴: نمودار طیف جذبی بر حسب طول موج نمونه های با ۱۶ ساعت رسوب گیری در دماهای رشد ۳۰۳، ۳۱۳ و ۳۲۳ کلوین

مشاهده می شود با افزایش دمای رسوب گیری گاف انرژی نواری کاهش پیدا کرده است.

۳-۳ تعیین عناصر موجود در لایه های نازک کبات سلنیید با آنالیز EDX

آنالیز کمی تعیین عناصر موجود در لایه تکنیک EDX در نقطه های مختلف جهت تعیین استوکیومتری انجام می شود. شکل ۵ طرح EDX یکی از نمونه ها را با جزئیات مرتبط با آنالیز برای

لایه نازک نانوساختار کبالت سلنید نمایش می دهد. درصد اتمی میانگین لایه کبالت سلنید ۵۴/۳۳۸ به ۴۵/۶۱۲ است. پیک های سیلیسیم و کلسیم مربوط به عناصر درون زیرلایه می باشد. درصد اتمی میانگین کلسیم ۷/۹۸۲ از درصد کل اتمی است. آنالیز عنصری همه نمونه ها انجام شد و یکی از بین همه آنالیزها در شکل ۵ نمایش داده است. نسبت عناصر با هم برابر نیست ولی با دقت چند درصد با هم اختلاف دارند.



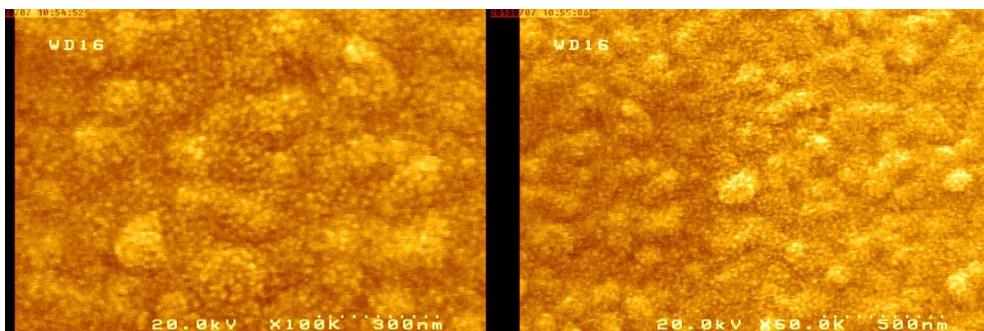
شکل ۵: آنالیز عنصری با EDX

۴-۳ توصیف لایه های نازک کبالت سلنید با میکروسکوپ الکترونی روبشی

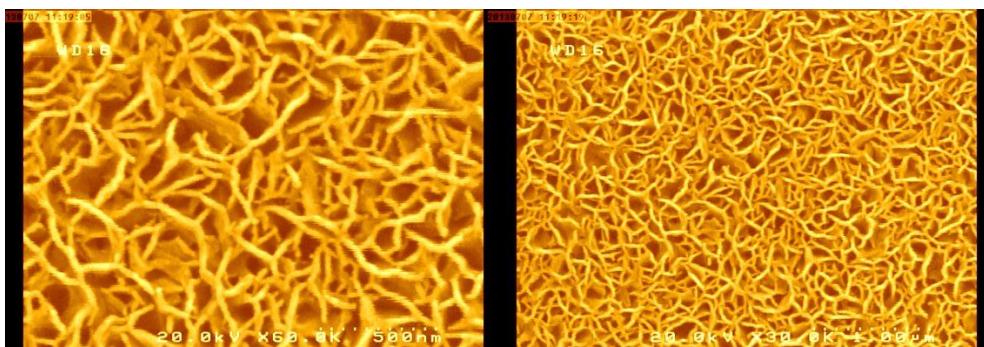
میکروسکوپ الکترونی روبشی بسیار ابزاری کارآمد در توصیف شکل نانوذرات و نحوه آرایش آنها است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی در تصاویر ۶، ۷ و ۸ به خوبی گویای این واقعیت است که تغییر دما هنگام رسوب گیری نقش بسیار مؤثری در تغییر شکل نانوذرات همچنین آرایش و چینش آنها دارد. مشاهده می شود در شکل ۶ رسوب گیری در دمای $30^{\circ}K$ لایه ها از نقاط کوانتوسومی بسیار ریزی تشکیل یافته اند و گاف انرژی آن $3/6$ الکترونولت است و در مقایسه با گاف انرژی توده ای آن $2/6$ بزرگتر شده است.

شکل ۷ لایه باکیفیتی است که از نانومیله‌هایی با قطر ۲۵ نانومتر تشکیل شده‌اند، دمای هنگام رسوب‌گیری K° ۳۱۳ و گاف انرژی نواری آن $3/3$ الکترون‌ولت است.

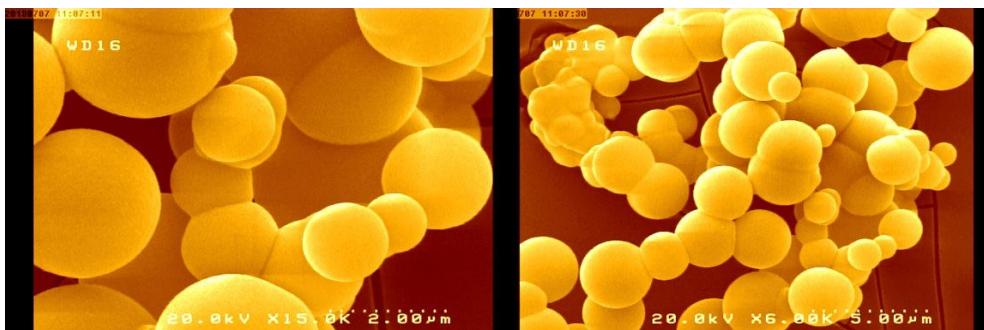
شکل ۸ لایه‌ای است که از نانو کره‌هایی تشکیل یافته‌اند. دمای هنگام رسوب‌گیری K° ۳۲۳ و گاف انرژی نواری آن $1/8$ الکترون‌ولت است.



شکل ۶: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ۱۶ ساعت رسوب‌گیری در دمای ۳۰۳ کلوین.



شکل ۷: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ۱۶ ساعت رسوب‌گیری در دمای ۳۱۳ کلوین.



شکل ۸: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ۱۶ ساعت رسوب‌گیری در دمای ۳۲۳ کلوین.

۴. تشكير و قدردانی

از دکتر نادر قبادی که در این پژوهش به در آزمایشگاه حضورداشتند، تشكير و قدردانی می‌نماییم

۵. نتیجه گیری

روش رسوب‌گیری از محلول‌های شیمیائی یکی از کاربردی‌ترین روش‌های ساخت لایه‌های نازک نانوساختار به شمار می‌آید و کاربردهای بی‌شماری در زمینه ساخت باتری‌های خورشیدی دارد. در این کار اثر دمای رسوب‌گیری روی تغییر شکل آرایه‌های نانوساختار کبالت سلنید گزارش شده است. این آرایه‌ها روی زیرلایه‌های شیشه‌ای با روش ساده رسوب‌گیری از محلول شیمیایی رشد یافته‌اند. نتایج نشان داده شکل هندسی نانوذرات با دما قابل کنترل است. نمونه‌ها با اسپکتروسکوپی جذب برای تعیین گاف انرژی و میکروسکوپ الکترونی توصیف شده‌اند. روش ما در مقایسه با روش‌های دیگر ساده‌تر و ارزان‌قیمت‌تر است. مهم‌ترین نتیجه این کار روی تغییر شکل نانوذرات با دما تکیه دارد.

۵. منابع

- [1] C. Burda, X. Chen, R. Narayanan and M. A El-Sayed, Chemistry and Properties of Nanocrystals of Different Shapes, Chem. Rev 105(2005) 1025-1102.
- [2] R.B Kale, C.D Lokhande, Band gap shift, structural characterization and phase transformation of CdSe thin films from nanocrystalline cubic to nanorod hexagonal on air annealing. Semicond Sci Technol 20 (2005) 1–9.
- [3] K. L. Chopra, Thin film phenomena, Springer (1969).
- [4] R.S.Mane and C.D.Lokhande, Chemical deposition method for metal chalcogenide thin films Materials Chemistry and Physics 65(2000)1-31.

- [5] L.E. Brus, Electronic wave functions in semiconductor clusters: experiment and theory
J. Phys. Chem, 90 (1986) 2555.
- [6] J.Tauc, A. Menth, States in the gap, J Non-Cryst Solids, 569 (1972) 8-10.